

## 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム事業に関する規程

平成24年度九大規程第24号  
制定：平成24年 9月27日  
最終改正：平成26年 8月25日  
(平成26年度九大規程第17号)

(趣旨)

第1条 この規程は、九州大学ナノテクノロジープラットフォーム事業（文部科学省の委託事業「ナノテクノロジープラットフォーム」により九州大学（以下「本学」という。）が実施機関として行う事業をいう。以下「本事業」という。）を構成する微細構造解析プラットフォーム及び分子・物質合成プラットフォーム（以下「プラットフォーム」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施責任者)

第2条 プラットフォームにそれぞれ実施責任者を置き、本学の教員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

(共用設備)

第3条 プラットフォームにそれぞれ別表のとおり共用設備を置き、学内（共用設備の運用主体の組織を除く。）及び学外の利用（プラットフォームが測定等を代行することを含む。以下同じ。）に供するものとする。

2 共用設備にそれぞれ設備管理者を置き、当該設備が設置されている部局等の教員のうちから実施責任者が指名する者をもって充てる。

(共用設備を利用できる者)

第4条 プラットフォームにおいて共用設備を利用できる者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、次条の規定により利用の承認を受けたものとする。

- (1) 共用設備の運用主体の組織以外の本学の職員
- (2) 本学の職員以外の者

(利用の手続)

第5条 共用設備を利用しようとする者は、実施責任者に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用料等)

第6条 前条の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、別表に掲げる利用料を、所定の期日までに、経費の振替又は本学が指定する口座への振込みにより支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、総長が特に認める場合は、利用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の利用料は、原則として返還しない。

(利用の条件)

第7条 利用者は、設備管理者の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって共用設備を利用しなければならない。

(免責)

第8条 利用者が受ける損害のうち、次の各号のいずれかに該当する場合には、本学は、その責めを負わない。

- (1) 天変地異等のやむを得ない事由により共用設備の利用ができず、損害が生じたとき。
- (2) 利用者の責めに帰すべき事由によって損害が生じたとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、その利用に係る共用設備、備品等を滅失、破損又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(事務)

第10条 本事業に関する事務は、学内関係各課等の協力を得て、工学部等事務部において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、プラットフォームに関し必要な事項は、実施責任者が別に定める。

附 則

この規程は平成24年10月1日から施行する。

附 則 (平成24年度九大規程第37号)

この規程は平成24年10月22日から施行する。

附 則 (平成25年度九大規程第101号)

この規程は平成26年4月1日から施行する。

附 則 (平成26年度九大規程第17号)

この規程は平成26年8月25日から施行する。

別表（第3条、第6条関係）

1. 微細構造解析プラットフォーム

共用設備名	利用料 (1枠(4時間)あたり)
超高压電子顕微鏡 (JEM-1300NEF)	11,300円
収差補正走査/透過電子顕微鏡 (JEM-ARM200F)	9,100円
三次元観察電子分光型電子顕微鏡 (JEM-3200FSX)	10,000円
ローレンツ電子顕微鏡 (TECNAIG2-F20)	8,600円
デジタル分析電子顕微鏡 (TECNAIG2-20)	8,300円
マイクロカロリメータSEM (マイクロカロリメータ高エネルギー分解能元素分析装置)	6,800円  (備考) 本機器利用の際、液体ヘリウムを使用する場合は、実費徴収とする。
デュアルビームFIB	6,200円
広電圧超高感度原子分解能電子顕微鏡	9,400円
フィルム料金 (1枚あたり)	260円

2. 分子・物質合成プラットフォーム

共用設備名	利用料	
	設備利用 (1時間あたり)	代行測定
高性能X線光電子分光分析装置	2,200円	24,000円 (1件あたり)
動的二次イオン質量分析測定装置	1,500円	3,900円 (1時間あたり)
表面・界面分子振動解析装置	1,400円	4,500円 (1時間あたり)
高速レーザーラマン顕微鏡	2,000円	4,900円 (1時間あたり)
レーザーラマン分光光度計 NRS-2000	3,300円	
プローブ型顕微ラマン分光測定装置	1,600円	4,600円 (1時間あたり)

レーザーラマン分光光度計 NRS-3100KK	2,300円	4,900円 (1時間あたり)
UV-Vis-NIR分光光度計	600円	3,600円 (1時間あたり)
紫外可視近赤外分光測定装置	1,500円	4,400円 (1時間あたり)
超高速 HPLC 分離・分子構造分析システム	1,900円	4,800円 (1時間あたり)
近赤外蛍光分光装置 Fluorolog-NIR	1,500円	4,100円 (1時間あたり)
近赤外蛍光分光装置 NanoLOG-EXT	1,000円	4,000円 (1時間あたり)
シングルフォトンカウンティング蛍光寿命計測装置	1,200円	4,100円 (1時間あたり)
超伝導核磁気共鳴吸収装置	940円	1,500円 (1件あたり)
質量分析装置	680円	2,700円 (1時間あたり)
MALDI-TOF質量分析装置	1,700円	4,500円 (1時間あたり)
分離用小型超遠心機	330円	3,300円 (1時間あたり)
分取HPLCシステム	4,200円	7,200円 (1時間あたり)
走査型プローブ顕微鏡 PicoPlus 5500	570円	3,200円 (1時間あたり)
表面抵抗率計	830円	3,800円 (1時間あたり)
表面形状測定装置	750円	3,200円 (1時間あたり)
走査型プローブ顕微鏡 SPM-9600	1,200円	4,100円 (1時間あたり)
走査型プローブ顕微鏡測定システム	2,500円	5,400円 (1時間あたり)
環境制御型ユニット付き多機能走査型プローブ顕微鏡	820円	3,300円 (1時間あたり)
環境制御型多機能走査型プローブ顕微鏡	380円	3,500円 (1時間あたり)
超高分解能走査電子顕微鏡	1,500円	4,500円 (1時間あたり)
3次元SEM画像測定解析システム	1,100円	4,000円 (1時間あたり)
走査型電子顕微鏡	1,900円	4,500円 (1時間あたり)

透過型電子顕微鏡システム	880円	3,800円 (1時間あたり)
ゼータ電位／粒径測定システム	1,100円	4,100円 (1時間あたり)
ゼータサイザーゼータ電位・粒子径・分子量測定装置	2,200円	6,200円 (1時間あたり)
動的光散乱測定装置	960円	4,000円 (1時間あたり)
全自動水平型多目的X線回折装置	2,300円	5,200円 (1時間あたり)
単結晶高速X線構造解析装置	3,200円	36,000円 (1件あたり)
マイクロカロリメトリー	2,500円	5,400円 (1時間あたり)
蒸気圧式絶対分子量測定装置	260円	2,900円 (1時間あたり)
蒸気圧式分子量測定装置	260円	3,400円 (1時間あたり)
分子構造解析システム	320円	3,300円 (1時間あたり)

## 九州大学ナノテクノロジープラットフォームに関する内規

(平成24年10月 1日 制 定)

(平成24年10月22日 最終改正)

### (趣旨)

第1条 この内規は、九州大学ナノテクノロジープラットフォーム事業に関する規程（平成24年度九大規程第24号。以下「規程」という。）に定めるもののほか、共用設備に関し必要な事項を定めるものとする。

### (利用の手続き)

第2条 規程第5条の規定により共用設備を利用しようとする者は、設備を利用しようとする日の20日前までに、所定の申請書により申請しなければならない。

2 規程第2条の実施責任者は、当該申請が適切であり、本学の教育研究に支障がなく、利用を承認することが当該申請をした者の研究等に資すると認めるときは、これを承認するものとする。

3 実施責任者は、試料を用いた共用設備の利用が申請された場合で、その試料を利用することが不適切と判断したときは、共用設備の利用を承認しないことがある。

### (利用の条件)

第4条 利用者は、利用の承認を受けた目的以外に共用設備を利用し、又は第三者に利用させてはならない。

2 規程第3条第2項の設備管理者は、利用者がこの内規又は規程に違反し、共用設備の利用に重大な支障を生じさせたときは、第2条第2項の承認を取消し、又は利用を停止することができる。

### (秘密の保持)

第5条 本学及び利用者は、共用設備の利用の過程において知り得た相手方の秘密情報、知的財産等（以下「秘密情報等」という。）を相手方の書面による同意なしに公開してはならない。

2 本学及び利用者は、秘密情報等の取扱いに関し、必要に応じ、秘密保持覚書書等を作成する。

### (雑則)

第6条 この内規に定めるもののほか、設備の利用に関し必要な事項は、設備が設置されている部局等の長が別に定めるところによる。

### 附 則

この内規は、平成24年10月1日から施行する。

### 附 則

この内規は、平成24年10月22日から施行する。